

イオン エッチング システム Ion Etching system

超硬切削工具・金型の再生、リサイクルを可能にします

超硬の除膜可

特長

- ・ 除膜時の超硬合金へのダメージを最小限に抑制
- ・ 各種コーティング除膜に対応：ダイヤモンドコーティング / PVD/CVD
- ・ 微細バリの除去や先鋭化にも適用可能

仕様

型式	IE300 (通称:コンパクトIE)	IE400	IE600	IE800
イオンガン数	3	4	6	8
装置質量	約700kg	約1,600kg		
装置サイズ	W800 x D1,200 x H1,700mm	W2,300 x D1,400 x H2,350 mm		
搭載量 (工具の場合)	最大12本	最大36本		
使用ガス	アルゴン、酸素			
電源容量 (3相200V A種接地)	9kVA	19kVA	25kVA	31kVA



イオンエッチング装置 “IE600”



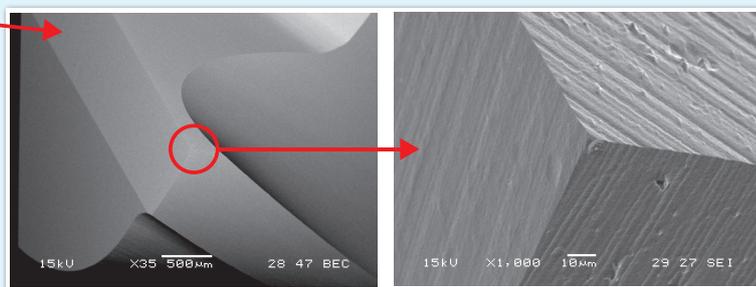
コンパクトイオンエッチング装置 “IE300”

新たに、小型のラインナップを拡充！

金型や部品など小量多品種の除膜ニーズに特化した小型版を開発。
除膜適用範囲は、従来機と同様に全膜種が可能です。
価格を抑えることで、除膜でお困りの幅広い分野のお客様へ提供できます。

除膜後も形状やシャープエッジを維持！

除膜サンプル AlCrN 系



【対応膜種】

カーボン系：ダイヤモンドコーティング (PCD), ダイヤモンドライクカーボン (DLC)
窒化物系：TiAlN, AlCrN, TiN, TiCrN, CrN etc.